

## パワーデバイス用無電解ニッケル/金, 無電解ニッケル/パラジウム/金めっきプロセス Electroless Ni/Au, Ni/Pd/Au Plating Process for Power Device

# トップUBPプロセス TOP UBP PROCESS

### ● アルミニウムおよびアルミニウム合金スパッタ膜へのめっきプロセス

Plating process for aluminum- and aluminum-alloy sputtering layer

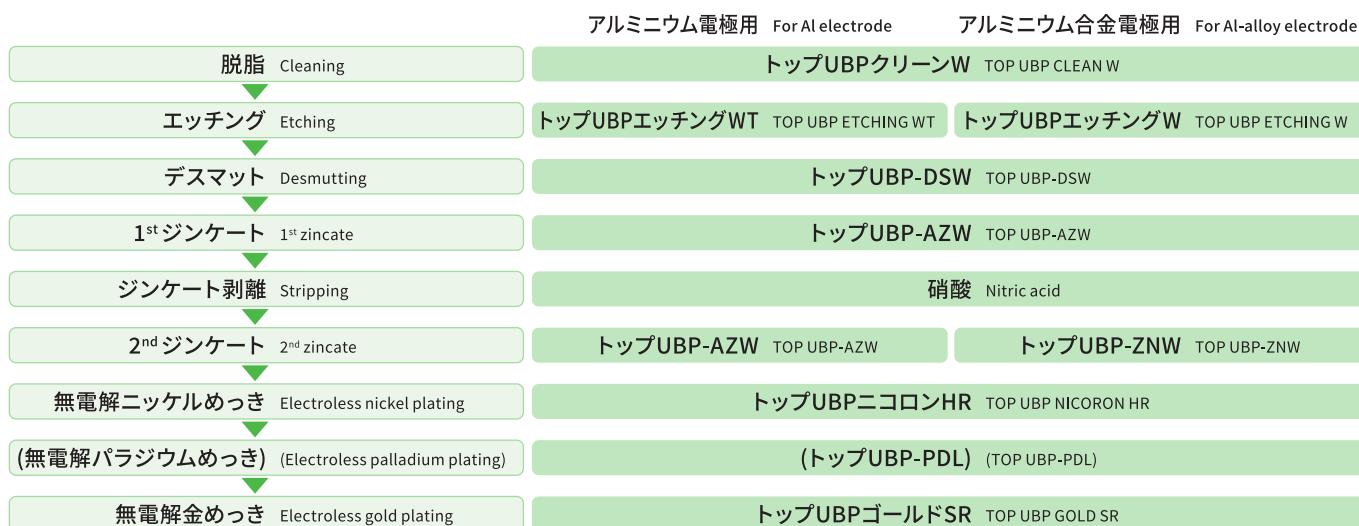
### ● 前処理によるエッチングが均一で、局部的腐食(スパイク)が少ない

Improve uniformity in etching process, can prevent local corrosion and Ni spike

### ● ジンケートが緻密に析出するため、めっき平滑性に優れる

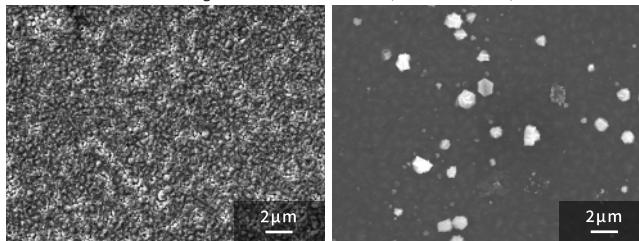
Make zincate film finely, increase smoothness of deposit

### 処理工程 Process



### 緻密なめっき皮膜 Fine and uniform plating film

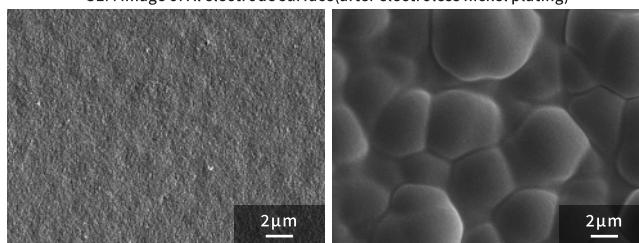
2<sup>nd</sup> ジンケート後の表面SEM外観(アルミニウム電極上)  
SEM image of Al electrode surface(after 2<sup>nd</sup> zinate)



トップUBPプロセス (アルミニウム電極用)  
TOP UBP PROCESS (For Al electrode)

従来プロセス  
Conventional process

無電解ニッケルめっき後の表面SEM外観(アルミニウム電極上)  
SEM image of Al electrode surface(after electroless nickel plating)



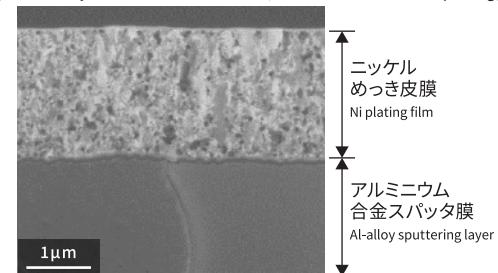
トップUBPプロセス (アルミニウム電極用)  
TOP UBP PROCESS (For Al electrode)

従来プロセス  
Conventional process

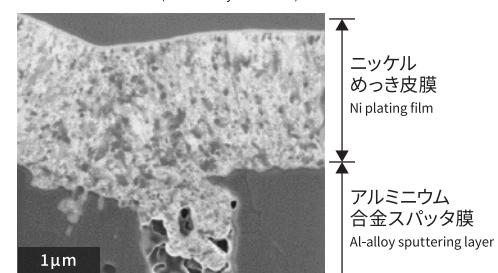
### 局部腐食の少ない前処理

Prevent local corrosion by improving pre-treatment

無電解ニッケルめっき後の断面 (アルミニウム合金電極上)  
SEM image of Al-alloy electrode cross section (after electroless nickel plating)



トップUBPプロセス (アルミニウム合金電極用)  
TOP UBP PROCESS (For Al-alloy electrode)



従来プロセス  
Conventional process